

株式会社 イズミズ 御中

水素ガス 依頼分析結果

測定結果

検体No.	サンプル名	測定日時	測定時間	測定値/単位
1	ラブリエエラン水素発生口から採取	2018年5月25日10:26	320sec.	100.36 %
2	ラブリエエラン水素発生口から採取	2018年5月25日10:55	320sec.	98.522 %
3	ラブリエエラン ノーズセットから採取	2018年5月25日11:30	320sec.	96.876 %
4	ラブリエエラン ノーズセットから採取	2018年5月25日11:44	320sec.	97.936 %

ラブリエエランから発生する水素(H₂)ガス濃度(n=2平均値)

水素発生口から採取 99.4%

ノーズセットから採取 97.4%

方法・条件

- 1.2. ラブリエエランの水素発生口から1mlサンプリングし希釈後トライライザーにて計測した。
 - 3.4. ノーズセットから1mlサンプリングし希釈後トライライザーにて計測した。
- ※ 水素測定値の算出方法。実測値に希釈率の逆数を乗じた。

測定方法、測定環境

	測定方法	GC-SCD法	室温	23°C
	採取方法	ガスタイトシリンジ	湿度	52%
	標準ガス値LOW	4.83ppm	天候/気圧	快晴/1007hpa
	標準ガス値HIGH	49.5ppm	採取者	池田大祐

精度確認

	測定前標準ガスLOW	2018年5月25日8:49	320sec.	4.823 ppm
	測定前標準ガスHIGH	2018年5月25日8:43	320sec.	49.864 ppm
	測定前室内空気	2018年5月25日10:05	320sec.	0.726 ppm
	測定中標準ガスHIGH	2018年5月25日11:02	320sec.	49.355 ppm
	測定後標準ガスHIGH	2018年5月25日11:50	320sec.	49.551 ppm

測定者

大阪市城東区森之宮2-4-29

株式会社タイヨウ

